

フォトレジストフィルター

Photoresist Filters

ろ 材	ポリプロピレン, ポリエーテルスルホン, ナイロン, PTFE, PVDF
規 格	1/8", 1/4", Ø8mm Swagelok
ろ過精度	20, 30, 50 nm 0.1, 0.2, 0.45, 1, 3, 5, 10 µm
操作範囲	4.0 bar at 25°C
主要用途	フォトレジストろ過, TFT-LCD製造プロセス



クイックリリース(ロング)



クイックリリース(ショート)



8 mm



1/4" Swagelok



クイックリリース



ALL PFA



クイックリリース



シリンジフィルター